UV酸化による微量有機物の除去

Removal of Trace Organic Matter with Ultraviolet Oxidation



知 福 博 行 Hiroyuki Chifuku

半導体・液晶製造等の電子工業において排水回収を行う場合,回収率を70~80%に高めるためには TOCが数mg/Lの低濃度有機排水やさらに濃度の高い有機排水の回収が必要となってくる。 UV酸化法は有機物を CO₂や H₂O等にまで酸化分解でき微量有機物の除去に適しているため従来より低 濃度有機排水の回収に使用されてきたが,電力消費量が大きいためランニングコストの低減が求められ ている。

本稿ではUV酸化装置の省エネルギーを目的に従来より使用されてきた高圧UVランプに代えて低圧 UV ランプの適用を検討した。その結果,水温,酸化剤量,撹拌条件を最適化することにより消費エネ ルギーを50%に削減できることがわかった。

To increase water recovery rate up to 70-80%, even high strength organic wastewater, in addition to low strength wastewater containing several mg TOC per liter, must be recovered in the semiconductor and liquid crystal display manufacturing industry. By decomposing organic matters into CO_2 , H_2O , etc., the ultraviolet oxidation method is effective in removal of residual trace organic matters. But the method consumes considerable electric power causing high running cost. An application of low-pressure mercury lamp, instead of high-pressure mercury lamp was studied for energy saving. The study demonstrated 50% reduction of power under optimum operating conditions such as water temperature, oxidizing agent, and agitating conditions.

Key Words :

半		導			体	Semiconductor
液					闘	Liquid crystal display
Т		0			С	TOC
U	V		酸		化	Ultraviolet oxidation
低 圧	U	V	ラ	ン	プ	Low-pressure mercury lamp
高 圧	U	V	ラ	ン	プ	High-pressure mercury lamp

まえがき

半導体・液晶製造等の電子工業においては廃棄物の削減 や排水の回収が進められているがこれらの工場では排水の 分別収集を適切に行うことにより,経済的にセミクローズ ド化を実施することが可能である。¹

回収は低濃度無機排水から始めるケースが多いが,回収 率を70~80%に高めるためにはTOC濃度が数mg/Lの低 濃度有機排水やさらに濃度の高い有機排水の回収も²¹不可 欠となってくる。しかし,有機排水を回収する場合には, 設備コストやランニングコストが低濃度無機排水の場合よ り割高になることが多く,コストと回収のメリットを十分 に検討する必要がある。

低濃度有機排水の成分としては IPA,メタノール,アセ トン,TMAH,DMSO,フェノール,酢酸,界面活性剤 等がある。これらの有機物の中には RO 膜(逆浸透膜)や イオン交換樹脂により除去できるものもあるが,膜や樹脂 へのファウリングの危険性がある。また濃縮液や再生廃液 中へ有機物が濃縮されるためこの廃液の処理が必要となる 場合もある。そのため有機物を CO₂や H₂O 等にまで酸化 分解できる UV 酸化処理や生物処理が採用されるケースが 多い。

この UV 酸化処理には高圧 UV ランプを使用する高圧



第1図 低圧UVランプのスペクトル分布

Fig. 1 Spectral distribution of low-pressure mercury lamp

UV酸化法と低圧 UVランプを使用する低圧 UV 酸化法の 2種類がある。低圧 UVランプは高圧 UVランプと比較し て発光効率は良いが100 W程度のものしか製作されておら ず,そのためランプ本数が高圧ランプに比べ非常に多くな り,これまで排水回収では使用されていなかった。しかし 最近では数百W以上の高出力低圧 UVランプが製造される ようになり,低濃度有機排水への適用が可能となってきた。

本稿ではこの高出力低圧 UVランプを低濃度有機排水の 回収に使用することを検討したのでその結果について報告 する。

UV酸化処理について

1.1 紫外線の分類

UV (Ultraviolet:紫外線)とはX線と可視光線との間 の約100~400 nmの波長域を総称したものである。UV は その作用によりさらに320~400 nmの UV—A (色素沈着, 光化学作用), 280~320 nmの UV—B (ビタミン生成, 紅 斑の生成), 180~280 nmの UV—C (殺菌作用) に分類さ れている。

1.2 UVランプの種類と特徴

UVランプは基本的には水銀ランプの一種でありランプ 内の水銀蒸気圧で高圧ランプ,低圧ランプに分けられてい る。高圧 UVランプはランプ内の水銀蒸気圧が1~10 atm, 低圧UVランプで0.01 mmHg程度である。また放射される波 長分布は封入されている水銀蒸気圧により変化し,特徴的 な輝線部を有している。第1図に本実験で使用した低圧 UVランプのスペクトル分布を,第2図に高圧 UVランプ のスペクトル分布の例を示した。

低圧 UVランプでは185 nm (オゾン線), 254 nm (殺菌 線)の出力が大きく、水分子に作用しヒドロキシラジカル を生成するため、数十 μ g/L 濃度の TOC であれば過酸化 水素を添加せずに酸化分解することができる。このため低 圧 UV ランプは 2 次純水装置等で TOC 除去・殺菌装置と して使用されている。

高圧UVランプのスペクトルは連続に近く,また185 nm のスペクトルは認められない。単独では酸化作用が極めて



第2図 高圧UVランプのスペクトル分布

Fig. 2 Spectral distribution of high-pressure mercury lamp

第1表 結合解離エネルギー Table.1 Bond dissociation energy

Bond	Dissociation energy kcal/mol	Bond	Dissociation energy kcal/mol
C-C	82,6	C=O aldehydes	176
C = C	145.8	C = O ketones	179
C-C1	81	C - H	98.7
C - F	116	N-H NH3	102.2
C-N	72.8	S-0	119
C=N	147	N = 0	162

弱いため、過酸化水素等の光増感剤を併用する。低圧 UV ランプより発光効率は悪いが数十kWの大容量のランプが 製作できるため、排水回収で用いられることが多い。

3 酸化分解の機構

有機物の酸化分解には次の2つのメカニズムが関与して いる。

①UVの持つエネルギーにより直接有機物内の結合を開 裂する。

②185 nmの UV は(1)式のように H₂O よりヒドロキシラ ジカル(・OH)を生成し、これが有機物を酸化分解 する。

$$H_2O + h_{\nu} \rightarrow H \cdot + \cdot OH \tag{1}$$

νは振動数である。

光のもつエネルギーは波長 λ に反比例し,次式で示される。

- $E = N \cdot h \cdot c \diagup \lambda$
 - *E*: 光量子 1 mol のエネルギー
 - h : プランクの定数6.626×10⁻³⁴ J·sec
 - c : 光速 2.998×10⁸ m/sec
- N:アボガドロ数6.022×10²³/mol

第2表 実験装置の仕様 Table.2 Specifications of the test unit

Item	Specification
Low-pressure mercury lamp High-pressure mercury lamp	670 W 1 kW
Reactor	SUS304 900mm∮×1500mmH 890 L

Jをkcalに、 λ をnmに換算すると

 $E = 2.859 \times 10^4 \text{ kcl} / \lambda$

例えば185 nmでは *E*=155 kcal/mol, 254 nmでは113 kcal/mol, 365 nmでは78.3 kcal/molである。

分子の結合を開裂させるのに必要な結合解離エネルギーの例を第1表に示した。365 nmでは難しいが185 nmでは 殆どの結合を開裂することができる。

このため185 nmの放射が殆ど無い高圧UVランプでは光 増感剤として過酸化水素を添加する。また,数mg/Lの TOCを含む排水の処理に低圧 UVランプを適用する場合 にはヒドロキシラジカルの生成能力が不足するため,高圧 UVランプと同様に過酸化水素の添加が必要となる。過酸 化水素からヒドロキシラジカルが生成する反応を(2)式に 示した。

 $H_2O_2 + h_{\nu} \to 2 \cdot OH \tag{2}$

このようにして生成させたヒドロキシラジカルは2.8 V という高い酸化ポテンシャルを持っている。これはオゾン の2.07 Vと比較しても高く,フッ素の3.06 Vに近い強い酸 化力をもっているため UV 酸化の効率を高めるのに有効で ある。

2. 低圧UVランプの特性

2.1 実験装置

実験装置のフローを第3図に,機器の仕様を第2表に示 した。実験は模擬排水について回分法で行い,比較のため に高圧 UVランプについても実施した。反応槽は SUS304 で製作し内面はバフ仕上げとなっている。槽内の撹拌は空 気攪拌とポンプ循環を併用しており,トレーサーを投入し て混合状態を調べた結果約3分間の撹拌で槽内は均一に混 合されていた。

低圧 UVランプは高出力型の670 Wのものを使用した。 このランプはジャケット管を使用せず,ランプ本体が直接 反応液と接する直浸型である。このためジャケット管によ る UV の減衰が無く,またジャケット管内への窒素ガスの 供給が不要であるため構造が簡単になっている。

実験に使用した模擬排水は純水に試薬を溶解して調整した。IPA を評価の基準としたが、この他メタノール、アセトン、TMAH についても実験をおこなった。実験結果は UV 酸化分解反応を1次反応に近似し反応速度定数k(1/ h)を求め、この大小にて評価した。

過酸化水素の添加量は各有機成分のTh-TOD(理論全酸 素要求量)をもとに決定した。



第3図 実験装置フロー Fig. 3 Schematic diagram of UV oxidation test





2.2 紫外線の透過特性

反応槽内で効率良くヒドロキシラジカルを生成させ、有 機物の酸化を進めるためには液全体にUVを照射する必要 があるが、UV領域は過酸化水素や有機物等に吸収され易 いため被処理液のUV透過特性を把握する必要がある。

第4図は IPA を純水に TOC で 3 mg/L 溶解し, さらに 過酸化水素を60 mg/L 添加したものについて190 nm から 270 nmの波長の吸光度を測定したものである。おおよそ 195 nmに最大値を持っているが, 254 nmでも吸光度が0.108



第5図 UV 254 nm の透過特性 Fig. 5 Transmittancce of UV 254 nm



第6図 攪拌の効果 Fig. 6 Effect of mixing

ある。185 nmにおける吸光度は測定していないが補外す ると1程度となる。

このようにして得られた吸光度を用い(3)に示した Lambert-Beer の式によって任意の透過距離における透過 率を算出した結果を第5図に示した。

$$-\log (I/I_0) = A_s = \beta \cdot C \cdot 1 \tag{3}$$

I/Io:透過率

- As : 吸光度
- : 吸収係数 β
- C :対象物質の濃度
- 1 : 液深

第5図では分解途中の状況を想定し,有機物濃度,過酸 化水素濃度の組み合わせを3段階に変化させているが、両 者の濃度が高い場合には透過率が非常に悪く、ランプ中心 より450mm離れるとUVの強度が1/10に低下する。また同 図は光束が平行の場合であるが、実際の UV ランプでは

神鋼パンテツク技報

反応槽内は空気撹拌、ポンプ循環による撹拌を行ってお り、この撹拌強度を変化させた。

IPAをTOCで2.5~4 mg/L, 過酸化水素をTh-TODの2~



第7図 低圧UVランプの温度特性

Fig. 7 Temperature dependency of low-pressure mercury lamp



第8図 水温の影響 Fig. 8 Effect of water temperature

360度全周に放射されるため透過距離の比に反比例し、さ らに減衰は大きくなる。

同図中に60 mg/Lの過酸化水素についての計算値を併記 した。この比較より過酸化水素60 mg/L に IPA を TOC で 3 mg/L 添加した液の254 nmUV の吸収は殆どが過酸化水 素によるものと考えられる。

185 nmのUV について透過率を計算すると被処理水中 を50 mm透過すると10%に、100 mm透過すると1%にまで 減衰することになり,透過は殆ど期待できないものと思わ れる。

以上より特に反応開始初期の過酸化水素の濃度が高い部 分では撹拌が重要である。また有機物濃度が高くなると, 過酸化水素の添加量も増えるため効率が低下してくること が予想される。



第9図 過酸化水素濃度の影響 Fig. 9 Effect of peroxide concentration



第10図 有機物の分解性



3 倍添加し, 撹拌強度を変化させた結果を第6図に示した。 空気撹拌及びポンプ循環のある場合が最も反応速度が速く, 空気撹拌量を1/3に低減するとkは72%に減少する。空気 撹拌単独, ポンプ循環単独ではkはほぼ等しく,本結果で は両者はほぼ同程度に寄与していた。

2.4 温度特性

低圧 UVランプではその水銀蒸気圧によってUVの放射 強度が変化する。水銀蒸気圧は管内温度にほぼ依存するた め結果的には UV 254 nmでは30~40 ℃付近で放射強度が 最大になると言われている。

本実験で使用した低圧UVランプはジャケット管を使用 せず被処理水にランプが接しているため、被処理水の水温 の影響を受けることになる。第7図に低圧UVランプの一 般的な温度特性を³⁾ 第8図に本実験で水温を20.3~38.5 ℃ まで変化させた場合のkの変化を示した。この結果でも35 ~40 ℃付近に最大値を持っており、この時のkの値は 20℃の時と比較して1.5倍となった。この値の中には温度 上昇による反応速度そのものの増加も含まれているが、35 ℃ 程度で温度コントロールすることは有効と考えられる。

2.5 過酸化水素濃度の影響



第11図 IPAのUV酸化 pH, EC Fig.11 UV oxidation of IPA pH, EC



第12図 IPAのUV酸化 TOC Fig. 12 UV oxidation of IPA TOC

過酸化水素の添加量は有機物のTh-TODをもとに決定 するが、反応中にUVによって自己分解するためTh-TOD より過剰に添加しなければならない。しかし過酸化水素自 身もUVを吸収するため透過率を低下させるので、過酸化 水素の添加量を増加させて行くと正の効果と負の効果が加 算され反応速度を最大にするような濃度が存在することに なる。

第9図に IPA の TOC を2.2~2.87 mg/L とし,過酸化水 素からの O_2 量の Th-TOD に対する倍率を0~4.6(過酸化 水素濃度として0~112 mg/L)に振った場合の k の変化を 示した。k の値は添加倍率が2.5~3倍では最大となり,さ らに添加倍率を増加させると急激に低下した。

また低圧 UVランプでは185 nmを放射するため,過酸化 水素を添加しない場合でも若干の反応が見られた。

2.6 有機物の分解性

IPA, アセトン, メタノール, TMAHについて TOC 2.2~2.9 mg/L, 過酸化水素の添加倍率2.8~3.3倍, 水温24.3 ~27.1 ℃の条件で試験した。第10図に示したようにTMA Hは非常に分解速度が遅く, 逆にメタノールは分解速度が 早かった。これらの有機物の酸化分解は直接CO₂やH₂Oま

で酸化されるのでは無く、(4)~(6)式に示したように酢酸、 蟻酸等の有機酸を経由して分解されると考えられる。

$$\begin{array}{ccc} -H_2 & +O_2 \\ (CH_3)_2(CH)OH \rightarrow (CH_3)_2CO \rightarrow CH_3COOH + CO_2 \\ & + H_2O (4) \\ IPA & アセトン 酢酸 \end{array}$$

$$-H_2 +O_2$$

CH₃OH → HCHO → HCOOH (5
メタノール ホルムアルデヒド 蟻酸

тт

$$+O_2$$

(CH₃)₂CO → CH₃COOH + CO₂ + H₂O (6
アセトン 酢酸

完全に酸化分解するためにはさらに酢酸、蟻酸の酸化分解 が必要となる。

このように酸化分解反応は逐次反応であるが。UV 酸化 槽内では各ステップの反応が併発的に進んでいると考えら れる。そこで IPA について、UV 酸化途中の電気伝導率、 pHの変化と、途中のサンプルについてイオン交換樹脂を 用いて有機酸を除去した後の TOC について調べた。

この結果を第11図に示した。pHはUV酸化開始ととも に緩やかに低下し、電気伝導率は急速に上昇している。こ れらは発生した CO₂の溶解と有機酸の蓄積によるものと 思われる。第12図にイオン交換樹脂による前処理のある場 合と無い場合,及びこれらの差より求めた有機酸の TOC を示した。処理開始1.5時間後に有機酸の TOC が最大となっ たがこの時点では全TOC 2.0 mg/Lに対してイオン交換後 の TOC が0.8 mg/Lであり、有機酸 TOC は1.2 mg/L あった。 2.5時間の時点では全 TOC がまだ1.3 mg/L 残留しているが イオン交換後の TOC は0.3 mg/L まで低下しているため, イオン交換樹脂を使用することによりシステムとしての効 率を大きく高めることが出来る。

3. 高圧UVランプとの比較

低圧 UVランプの場合と同じように, IPA について高圧 UVランプによる回分酸化試験を実施した。評価は TOC 除去率90%を得られる照射電力量Wmで行った。第13図に 示したように高圧 UV ランプでは W₂₀ が7.1 kWh/m³, 低圧



第13図 効率の比較 Fig. 13 Comparison of Performance

UVランプでは4.3 kWh/m³であり、低圧 UVランプの使用 により消費電力量が60%に削減できる。本実験条件は水 温が25~26 ℃であるから、2.4の結果より被処理水の水 温を35℃まで昇温して運転すればさらに反応速度定数が 0.54から0.62に上昇し、その結果 W₉₀が3.7 kWh/m³に改善 され消費エネルギーが約50%に削減できる。

むすび

高出力低圧 UVランプを使用し低濃度有機排水を処理す る場合,最適条件にて設計することにより従来の高圧 UV ランプの約50%のエネルギーで有機物を酸化分解出来る ことが明らかになった。また反応の中間体としての有機酸 が蓄積するために、UV 酸化装置とイオン交換樹脂を組み 合わせたシステムは UV 酸化装置の小型化に有効である。

電子工場の排水回収には膨大なエネルギーが消費されて おり廃棄物の削減とともに省エネルギーは水処理において も重要なテーマである。特に有機物の酸化分解には多くの エネルギーを必要とするため UV 酸化以外の省エネルギー な方法についても研究を進めて行く所存である。

[絵老文献]

- 1) 阿野真隆: 神鋼パンテツク技報, Vol. 39, No. 2 (1996), P 49
- 2) 知福博行:神鋼パンテツク技報, Vol. 38, No. 3 (1994), P 21
- 3) 照明学会,照明ハンドブック

連絡先

知福博行 環境装置事業部 製品開発室 課長 TEL 078 - 992 - 6532 FAX 078 - 992 - 6503 E-mail h. chifuku@pantec. co. jp